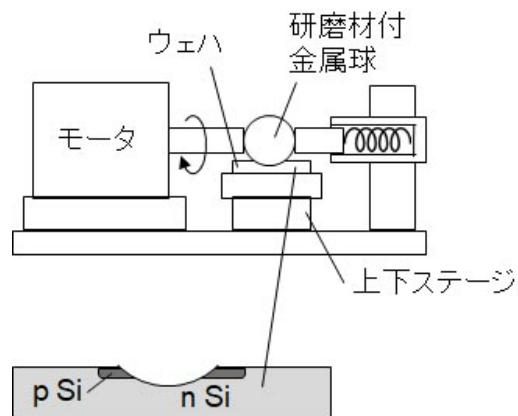
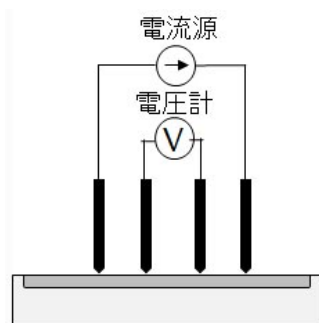


12 光以外の各種測定法



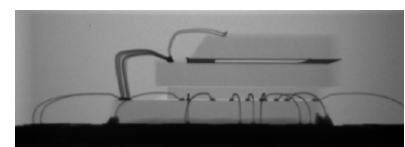
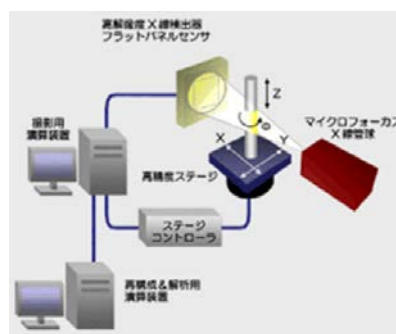
スフェリカルドリルで球面状に研磨後、p Si に着色し顕微鏡で拡散深さを測定



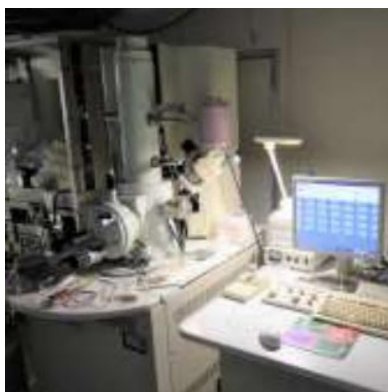
四探針法によるシート抵抗測定



原子間力顕微鏡(AFM)
(Park Systems NX-20)



マイクロ X 線 CT 装置(クリーンルーム 1F)とそれによる 3 軸加速度センサの断面



走査型電子顕微鏡 (SEM)



X 線回折装置